

RADICAL PLASMA SOURCE (REMOTE PLASMA SOURCE) - MA2000C-783BB

Catégorie: Composants plasma



UNDER
PROGRESS

INFORMATION ADDITIONNELLE

| | |
|---|---|
| Tapez | Source plasma à radicaux (Remote plasma Source) |
| Processus | Gravure et Dépôt (Revêtement) |
| Type de connexion de sortie | |
| Matériau Diélectrique | Céramique |
| Tension d'alimentation Nominal [V] | 230 / 208 |
| Puissance de sortie [W] | 2000 |
| Fréquence [MHz] | 2450 |